

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H01L 21/68	(11) 공개번호 특 1997-0053287	(43) 공개일자 1997년 07월 31일
(21) 출원번호	특 1995-0046094	
(22) 출원일자	1995년 12월 01일	
(71) 출원인	LG 반도체 주식회사     문정환	
(72) 발명자	문성열	
(74) 대리인	총청북도 청주시 흥덕구 사직 2동 주공아파트 128-508 심창섭, 김용인	

**심사청구 : 있음**

**(54) 웨이퍼 고정장치**

**요약**

본 발명은 웨이퍼 고정장치에 관한 것으로, 식각공정중 발생하는 에지부분의 불순물 발생의 원천적 제거에 적당한 웨이퍼 고정장치를 제공하기 위한 것이다. 이를 위한 본 발명의 웨이퍼 고정장치를 정전기를 이용하여 웨이퍼를 고정시키는 제1고정 수단부, 샤도우 클램프를 이용하여 상기 웨이퍼를 고정시키는 제2고정 수단부, 플라즈마 이온의 분산을 방지하기 위한 에지링부를 포함하여 이루어짐을 특징으로 한다.

**대표도**

**도3**

**명세서**

[발명의 명칭]

웨이퍼 고정장치

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명의 웨이퍼 고정장치를 나타낸 도면  
제4도는 본 발명에 따른 웨이퍼 에지부분의 확대도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

정전기를 이용하여 웨이퍼를 고정시키는 제1고정 수단부, 샤도우 클램프를 이용하여 상기 웨이퍼를 고정시키는 제2고정 수단부, 플라즈마 이온의 분산을 방지하기 위한 에지링부를 포함하여 이루어지는 웨이퍼 고정장치.

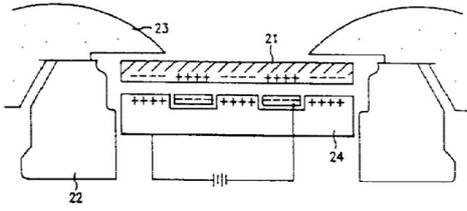
**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기 샤도우 클램프는 웨이퍼와 직접 접촉되지 않으며, 식각공정시 웨이퍼 에지 부분의 도전층이 식각되는 것을 방지함을 특징으로 하는 웨이퍼 고정장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면**

도면3



도면4

